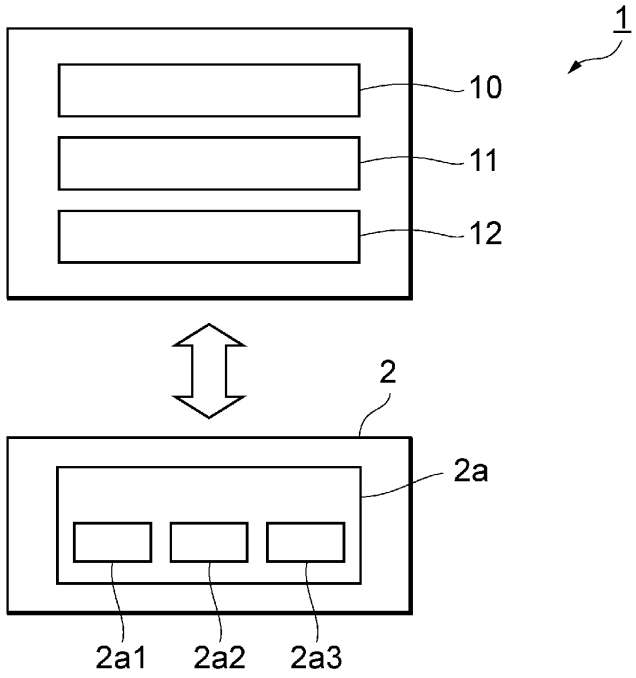
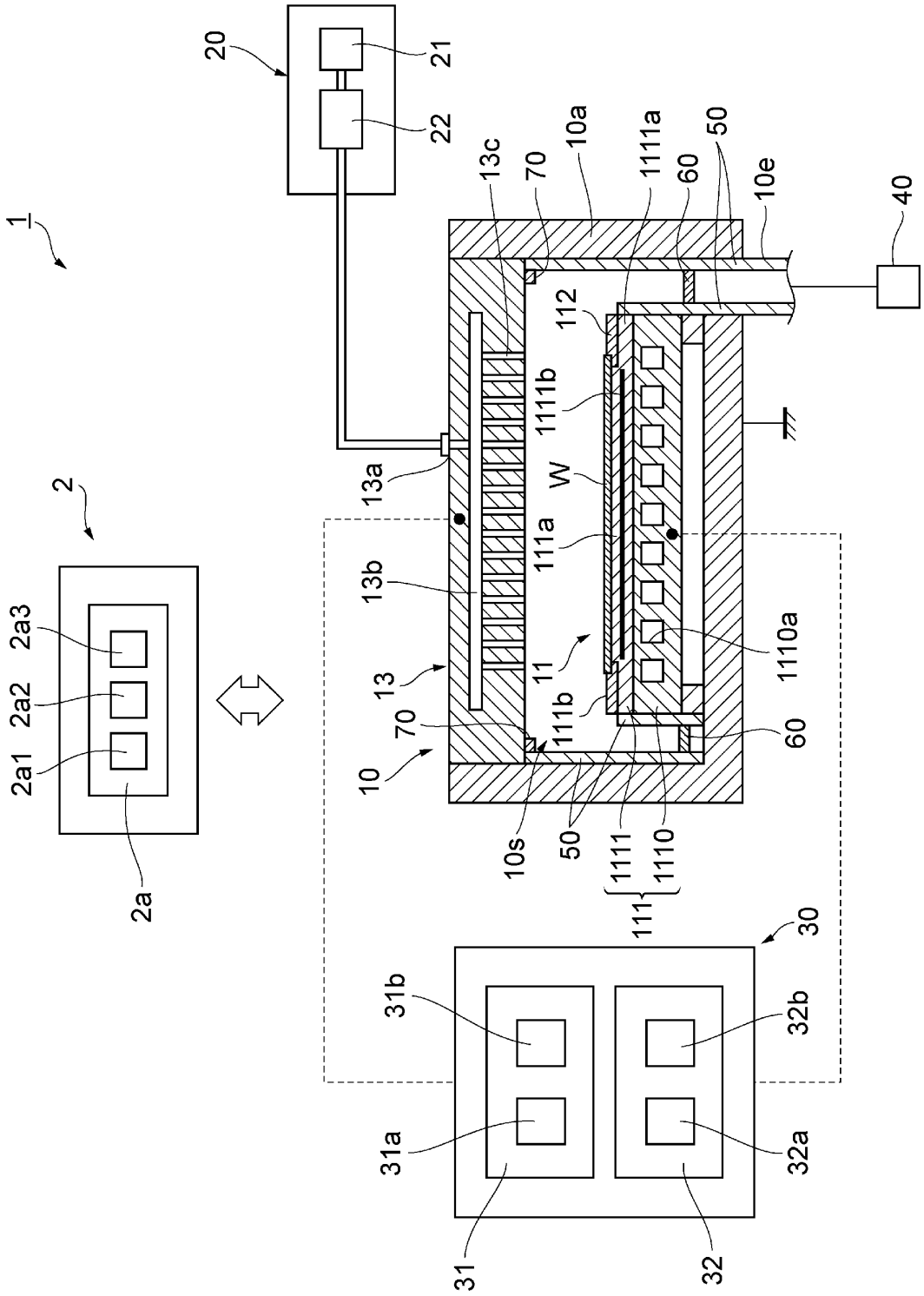
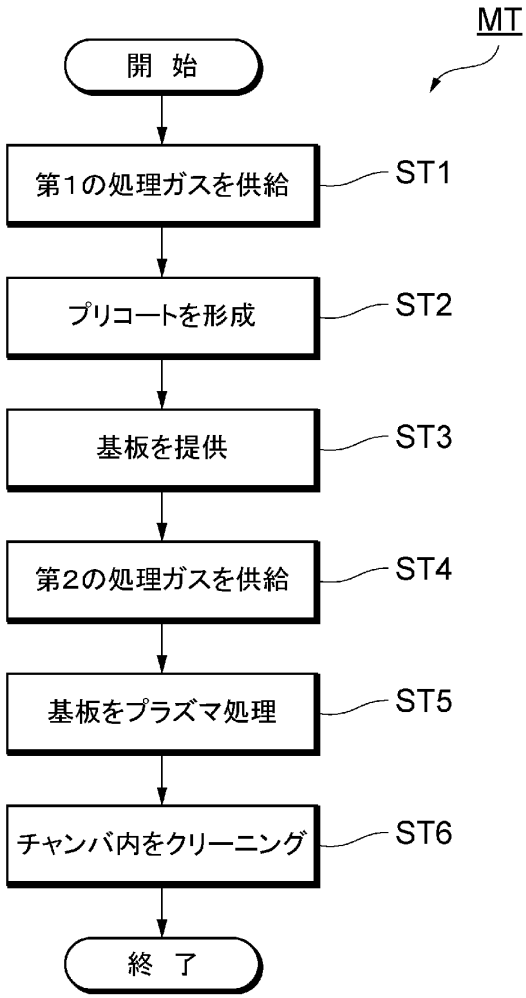
[図1]



[図2]


1
2
2a
2a1
2a2
2a3
20
21
22
10
10a
10e
10s
11
13
13a
13b
13c
30
31
31a
31b
32
32a
32b
40
50
60
70
111
111a
111b
1110
1110a
1111
1111a
1111b
112
W

[図3]


MT
開 始
第1の処理ガスを供給
ST1
プリコートを形成
ST2
基板を提供
ST3
第2の処理ガスを供給
ST4
基板をプラズマ処理
ST5
チャンバ内をクリーニング
ST6
終 了

[図4]

